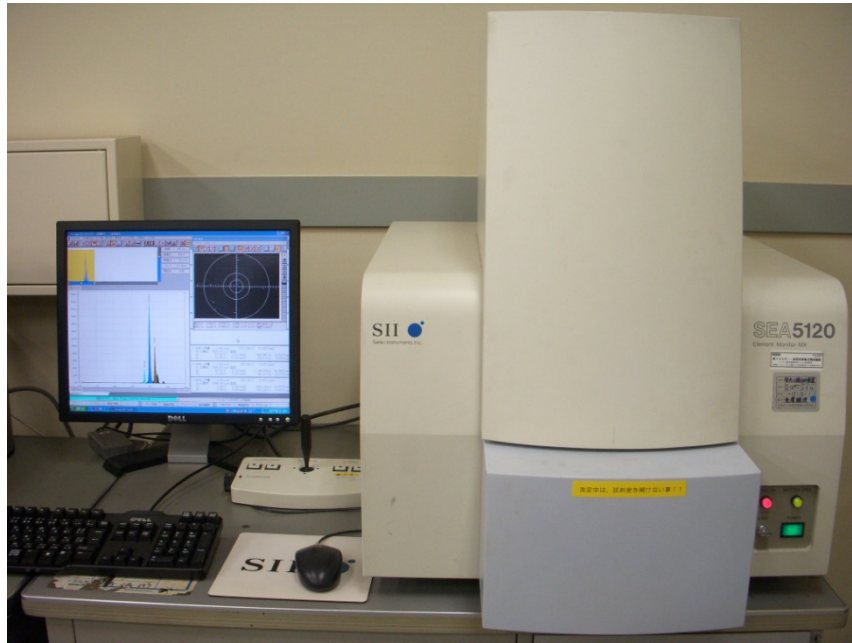


蛍光X線分析装置（膜厚測定対応、エネルギー分散型）



本装置は、試料にX線を照射し、そのとき放出される特性X線を検出することで、めっきの膜厚を測定する装置です。電解式膜厚計や顕微鏡による断面観察を用いる方法と異なり、試料を非破壊的かつ短時間（100秒程度）で測定することができます。

本装置は、最小φ0.1mmのコリメータを備えており、微小部分のめっき厚さについても測定が可能なほか、最大4層までの多層めっき膜厚測定、合金めっき皮膜の組成分析にも対応しています。

【適用例】

- ・亜鉛めっきボルト(鉄素材/亜鉛めっき)
- ・金めっき端子(銅素材/ニッケル/金めっき)
- ・金具(亜鉛ダイカスト/銅/ニッケル/クロムめっき)
- ・はんだめっきのPb含有(RoHS・ELV対策)

SII株式会社製 SEA5120

- ・測定可能試料：測定箇所が最表面にあり、縦80mm×横80mm×高さ30mmの範囲に収まる試料
- ・測定元素：原子番号11(Na)～92(U)
- ・試料台移動範囲：縦75mm×横75mm
- ・依頼試験料金：5,600円/1試料・1測定
- ・問い合わせ先：林(2640)、長瀧(2730)
- ・分析スポット：φ0.1mm または1.8mm
- ・厚さ測定範囲：数十nm～20μmまで(対象元素による)
- ・機器使用料金：10,800円/半日（指導料別途要）